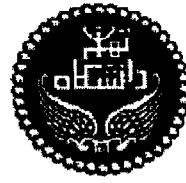
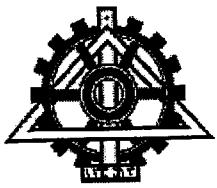


الله يحيي الموتى

٨٧٤.٨



## دانشگاه تهران

دانشکده فنی

# بررسی عوامل مؤثر بر پوشش دهی سرامیک اکسید روی با آلومینیوم به روش فلزپاشی

نگارش: حمیدرضا سلیمانپور



استاد راهنما

دکتر احمد علی آماده

اساتید مشاور

دکتر علی محمد هادیان

مهندس سید محمدرضا یوسف ثانی

۱۳۸۲ / ۱۰ / ۳۰

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در

مهندسی مواد و متالورژی

بهمن ۸۱

۳۸۴۰۸

موضوع:

## بررسی عوامل موثر بر پوشش دهی سرامیک اکسید روی

### با آلومنیم به روش فلز پاشی

نگارش:

حمیدرضا سلیمانپور

از این پایان نامه در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ در مقابل هیئت داوران دفاع به عمل آمد

و مورد تصویب قرار گرفت.



سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی: دکتر جواد فیض

مدیر گروه آموزشی: دکتر سید فرشاد اخلاقی

سرپرست تحصیلات تکمیلی گروه: دکتر حمیدرضا قاسمی منفرد راد

استاد راهنمای: دکتر احمد علی آماده

استاد مشاور: دکتر علی محمد هادیان

عضو هیئت داوران: دکتر محسن صارمی

عضو هیئت داوران: دکتر سید فرشید کاشانی بزرگ

عضو هیئت داوران: دکتر فرزاد مجتبی

## چکیده

سرامیک اکسید روی زینتر شده یک سرامیک الکترونیک نیمه‌رسانا است که به دلیل ویژگی مقاومت الکتریکی غیر خطی به عنوان برق‌گیر و تنظیم‌کننده ولتاژ کاربرد فراوانی در صنعت برق و الکترونیک دارد. برای اتصال این سرامیک به مدارهای الکتریکی و الکترونیکی، یک پوشش رسانای فلزی برروی دو وجه متقابل سرامیک اعمال می‌شود که نقش الکترود را ایفا می‌کند. الکترودگذاری سرامیک اکسید روی یک مرحله حساس و مهم در تولید این قطعات می‌باشد. الکترودگذاری و یا پوشش‌دهی سرامیک اکسید روی به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد که کاربرد هر روش بستگی به حداکثر ولتاژی دارد که سرامیک باید تحمل کند. پوشش‌دهی سرامیکهای اکسید روی اغلب به روش پاشش آلومینیوم مذاب صورت می‌گیرد. در این پایان‌نامه، عوامل مؤثر بر پوشش‌دهی سرامیک اکسید روی با روش پاشش آلومینیوم مذاب بررسی گردیده است.

با تشکر فراوان لز اساتید ارجمند

آقای دکتر آماده و آقای مهندس یوسف ثانی

که راهنمایی اینجانب را در به تهرساندن این پایان

نامه به عهده گرفتند.

تقدیم و تشکر از

جناب آقای دکتر معین

که این پایان نامه بدون توجهات ایشان به ثمر

نهی رسد.

تقدیم به پدر و هادر عزیزم  
که همیشه دوستشان دارم.

تقدیم په همسر عزیزم

تقدیم په

حاهد، حسام و ساسان عزیز

با تشکر از همکاری دوستان گرامی

آقای محمد صفرلو، سرکار خانم فرزانه فرجامی،

آقای هندرسون رضوانی، آقای هندرسون مؤذن احمدی،

آقای هندرسون پسیری پور

و سایر کسانی که به هر نحو همراه در تکمیل این

مجموعه پاری کردند.

## فهرست مطالب

فصل اول	فصل دوم
مقدمه	مقدمه
۱	۱-۲- پوشش‌های پاشش حرارتی ..... ۱
	۱-۱-۱- روش‌های پاشش حرارتی ..... ۱
	۱-۱-۱-۱- پاشش با قوس الکتریکی ..... ۴
	۱-۱-۱-۲- پاشش با شعله احتراقی ..... ۶
	۱-۱-۲- دینامیک تشکیل پوشش‌های پاشش حرارتی ..... ۸
	۱-۱-۲-۱- تغییر شکل ذرات ..... ۹
	۱-۱-۲-۲- دمای ذرات در هنگام برخورد به سطح ..... ۹
	۱-۱-۲-۳- جوانه‌زنی، انجماد و رشد بلورها ..... ۱۰
	۱-۱-۲-۴- مکانیسم‌های چسبندگی پوشش به سطح ..... ۱۰
	۱-۱-۲-۴-۱- اثر زبری سطح بر روی چسبندگی پوشش‌های پاشش حرارتی ..... ۱۲
	۱-۱-۲-۵- رشد پوشش‌های پاشش حرارتی ..... ۱۳
	۱-۱-۳- بررسی ویژگی‌های پوشش‌های پاشش حرارتی ..... ۱۴
	۱-۱-۳-۱- خواص مکانیکی ..... ۱۴
	۱-۱-۳-۲- ریزساختار ..... ۱۵
	۱-۱-۳-۳- خواص الکتریکی ..... ۱۷
	۱-۱-۴- آمده‌سازی سطوح پیش از پاشش حرارتی ..... ۱۷
	۱-۱-۴-۱- بازرگانی مقدماتی ..... ۱۸
	۱-۱-۴-۲- چربی‌زدایی و تمیزکاری ..... ۱۸

۱۸.....	۴-۳-۲-۱-۴-۳- ماسک‌گذاری پیش از آماده‌سازی سطح.....
۱۹.....	۴-۴-۱-۲-۱-آماده‌سازی سطح.....
۲۱.....	۵-۴-۱-۲-۱- ماسک‌گذاری قبل از پاشش حرارتی.....
۲۲.....	۲-۲-۱- وریستورهای اکسیدروی.....
۲۲.....	۱-۲-۱- ویرگیهای وریستورها.....
۲۲.....	۱-۱-۲-۲- خواص الکتریکی وریستورها.....
۲۴.....	۲-۱-۲-۲- شیمی وریستورها.....
۲۴.....	۳-۱-۲-۲- ریزساختار وریستورها.....
۲۵.....	۴-۱-۲-۲- فیزیک وریستورها.....
۲۵.....	۱-۴-۱-۲-۲- مکانیسمهای هدایت در وریستورها.....
۲۶.....	۲-۴-۱-۲-۲-۱- مدار معادل وریستورها.....
۲۷.....	۲-۲-۲- فرآیند تولید وریستورها.....
۲۷.....	۱-۱-۲-۲-۲- تهیه بلوک سرامیکی.....
۲۷.....	۲-۲-۲-۲- عملیات حرارتی.....
۲۸.....	۳-۲-۲-۲-۲- الکترودگذاری.....
۲۸.....	۱-۱-۲-۲-۲- ویژگی الکترودها.....
۲۹.....	۲-۳-۲-۲-۲- روش‌های الکترودگذاری.....
۳۱.....	۳-۲-۲-۲- مکانیسمهای تخریب وریستورها.....
۳۱.....	۱-۱-۲-۲-۳- ولتاژهای اضافی ناشی از رعد و برق و قطع و وصل مدار.....
۳۱.....	۲-۳-۲-۲-۲- ولتاژهای اضافی انتقالی در حین سرویس دهی.....
۳۱.....	۳-۳-۲-۲-۲- تجمع آبودگیها در محفظه خارجی وریستور.....
۳۲.....	۴-۳-۲-۲- تغییرات در فعالیت الکتریکی زمین.....

### فصل سوم

#### روش برداشت

۱-۳-۱- تهیه نمونه‌های پوشش داده شده.....	۳-۳.....
۱-۱-۳-۱- تهیه نمونه‌های سرامیکی پایه.....	۳۳.....
۱-۲-۳-۱- پرداخت سطح نمونه‌ها.....	۳۴.....
۱-۳-۱-۳- آماده‌سازی سطح نمونه‌ها.....	۳۴.....

۳۴.....	۱-۳-۱- حکاکی شیمیایی سطح
۳۵.....	۱-۳-۲- دمش ذرات کاربید سیلیسیم
۳۵.....	۱-۳-۳- بدون آماده سازی
۳۶.....	۱-۳-۴- تمیز کاری سطح پیش از پوشش دهی
۳۶.....	۱-۴-۱- تمیز کاری سطح با محلول تربانتین
۳۶.....	۱-۴-۲- تمیز کاری سطح با امواج فرماصوتی
۳۶.....	۱-۴-۳- پوشش دهی نمونه ها
۳۷.....	۲-۳- آزمایش های صورت گرفته بر روی نمونه های پوشش داده شده
۳۷.....	۲-۱-۱- بررسی با میکروسکوپ نوری
۳۷.....	۲-۱-۲- آماده سازی نمونه ها
۳۸.....	۲-۱-۳- بررسی های میکروسکوپی
۳۸.....	۲-۲-۱- بررسی با میکروسکوپ الکترونی
۳۹.....	۲-۲-۲- بررسی تخلخلها با استفاده از آنالیز تصاویر میکروسکوپی
۳۹.....	۲-۲-۳- تعیین زبری سطح آماده سازی شده
۴۰.....	۲-۲-۴- اندازه گیری استحکام چسبندگی پوشش به سطح
۴۰.....	۲-۲-۵- اندازه گیری ریز سختی پوشش

#### فصل چهارم

##### نتایج و بحث

۴۲.....	۱-۴-۱- بررسی های میکروسکوپ نوری
۴۳.....	۱-۴-۲- توپوگرافی سطحی
۴۴.....	۱-۴-۳- فصل مشترک پوشش / سرامیک
۴۶.....	۱-۴-۴- مکانیسم تشکیل پوشش
۴۷.....	۱-۴-۵- مورفولوژی پوشش
۴۸.....	۱-۴-۶- سطح زیر پوشش های جدا شده
۴۹.....	۱-۴-۷- شکل نوک الکترودهای مصرفی
۵۰.....	۱-۴-۸- تخلخل پوشش
۵۱.....	۱-۴-۹- زبری سطح
۵۲.....	۱-۴-۱۰- استحکام چسبندگی پوشش به سرامیک

۱۱-۴- سختی پوشش..... ۵۴

نتیجه‌گیری و پیشنهادات		فصل پنجم
۵۶	.....	۱-۵- نتیجه‌گیری
۵۹	.....	۲-۵- پیشنهادات

۶۳	.....	جدولها
۶۵	.....	شکلها
۸۲	.....	مراجع

## **فهرست جداولها**

جدول (۱-۳): پارامترهای فرآیند پاشش حرارتی که در تهیه نمونه‌ها بکار گرفته شده است.....	۶۳
جدول (۱-۴): نتایج اندازه‌گیری تخلخل پوشش نمونه‌های مختلف.....	۶۳
جدول (۴-۲): نتایج آزمون تعیین زبری سطح نمونه‌های مختلف.....	۶۳
جدول (۴-۳): نتایج آزمون استحکام چسبندگی پوشش در نمونه‌های مختلف.....	۶۴
جدول (۴-۴): نتایج آزمون اندازه‌گیری ریزساختی پوشش نمونه‌های مختلف.....	۶۴